# 物理学报 Acta Physica Sinica



### 电触发二氧化钒纳米线发生金属-绝缘体转变的机理

王泽霖 张振华 赵喆 邵瑞文 隋曼龄

Mechanism of electrically driven metal-insulator phase transition in vanadium dioxide nanowires

Wang Ze-Lin Zhang Zhen-Hua Zhao Zhe Shao Rui-Wen Sui Man-Ling

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 67, 177201 (2018) DOI: 10.7498/aps.67.20180835 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20180835 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2018/V67/I17

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

# VO2金属-绝缘体相变机理的研究进展

Research progress of metal-insulator phase transition mechanism in VO<sub>2</sub> 物理学报.2016, 65(4): 047201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.047201

#### 5d 过渡金属氧化物中的奇异量子物性研究

Novel properties of 5d transition metal oxides 物理学报.2015, 64(18): 187201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.187201

# 高温氢退火还原V2O5制备二氧化钒薄膜及其性能的研究

Properties in vanadium dioxide thin film synthesized from  $V_2O_5$  annealed in H<sub>2</sub>/Ar ambience 物理学报.2013, 62(22): 227201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.227201

### 金属 Pt 薄膜上二氧化钒的制备及其电致相变性能研究

Growth of vanadium dioxide thin films on Pt metal film and the electrically-driven metal--insulator transition characteristics of them

物理学报.2013, 62(21): 217201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.217201

# 二氧化钒薄膜低温制备及其太赫兹调制特性研究

VO<sub>2</sub> low temperature deposition and terahertz transmission modulation 物理学报.2013, 62(1): 017202 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.017202

# 电触发二氧化钒纳米线发生金属-绝缘体 转变的机理\*

王泽霖<sup>1</sup>) 张振华<sup>2</sup>) 赵喆<sup>1</sup>) 邵瑞文<sup>3</sup>) 隋曼龄<sup>1)†</sup>

1) (北京工业大学,固体微结构与性能研究所,北京 100124)

2) (杭州电子科技大学,浙江(杭电)创新材料研究院,杭州 310018)

3) (北京大学, 电子显微镜实验室, 北京 100871)

(2018年4月26日收到;2018年5月20日收到修改稿)

二氧化钒 (VO<sub>2</sub>)是一种强关联相变材料,在341 K下发生金属-绝缘体转变.尽管对于 VO<sub>2</sub> 相变的物理 机理进行了大量研究,但科学家仍未形成统一认识.与热致 VO<sub>2</sub> 相变相比,电触发 VO<sub>2</sub> 相变应用前景更为广 阔,但其机理也更为复杂.本文利用原位通电杆和超快相机技术,在透射电镜下原位观察了单晶 VO<sub>2</sub> 纳米线 通电时的相转变过程,记录了相变过程中对应的电压-电流值,并在毫秒尺度下捕捉到了 VO<sub>2</sub> 的过渡相态.发 现 VO<sub>2</sub> 电致相变并非由焦耳热引起,推断其机理是载流子注入.同时观察到电子结构相变和晶体结构相变存 在解耦现象,进一步支持了上述推断.将 VO<sub>2</sub> 纳米线两端施加非接触式电场,观察到 VO<sub>2</sub> 纳米线在电场中的 极化偏移,而未观察到相变发生,该现象同样支持相变的载流子注入机理.研究表明 VO<sub>2</sub> 的金属-绝缘体转变 遵循电子-电子关联机理,即根据电子关联的 Mott 转变进行.

**关键词**: 二氧化钒, 金属-绝缘体转变, Mott 相变, 原位透射电镜 **PACS:** 72.80.Ga, 71.30.+h, 73.63.-b, 68.37.Lp **DOI:** 10.7498/aps.67.20180835

# 1引言

二氧化钒 (VO<sub>2</sub>) 在温度升高到341 K时会发 生一级相变<sup>[1]</sup>,产生由绝缘体转变为导体的金属-绝缘体转变 (metal-insulator transition, MIT) 和由 单斜相 (M<sub>1</sub>)转变为金红石相 (R)的结构相转变 (structural phase transition, SPT).自1959年发现 MIT 以来,大量的实验和理论工作一直在探寻 VO<sub>2</sub> MIT 的机理<sup>[2-4]</sup>,因为在 VO<sub>2</sub>中,3d<sup>1</sup>电子强关联 导致的电子局域化 (电子-电子相互作用)和相变过 程中钒原子 (V) 二聚化带来的布里渊区的改变 (电 子-晶格相互作用)都存在于该体系中<sup>[5,6]</sup>.2014年, Morrison等<sup>[7]</sup>利用超快电子衍射发现了 VO<sub>2</sub>薄膜 中金属性质的单斜相中间态,给出了 MIT 在时间 尺度上先于 SPT 完成的证据,即电子结构转变领 先于原子结构转变完成,暗示电子-电子相互作用 可能主导了相变的发生.这一结果提供了通过观察 电子结构转变和原子结构转变解耦来研究 VO<sub>2</sub> 相 变机理的新思路.然而,由于实验中测试的 VO<sub>2</sub>薄 膜仍然附着在生长基底上,中间态的出现无法排除 VO<sub>2</sub>薄膜受基底应力调制的影响<sup>[8-10]</sup>.

相比于热致相变,电触发VO<sub>2</sub>相变应用更加 广泛,如场效应管、触发器等.然而,对于电触发相 转变背后的物理机理存在争议<sup>[11–14]</sup>.将VO<sub>2</sub>接 入闭合电路中,电压达到临界值,电流突然飙升,说 明发生MIT.有研究者将此归因于电场作用下载流 子直接注入,使电子库仑屏蔽作用崩塌触发相变的

\* 国家重点研发计划(批准号: 2016YFB0700700)、国家自然科学基金创新研究群体科学基金(批准号: 51621003)和北京市重点项目 (KZ201310005002)资助的课题.

†通信作者. E-mail: mlsui@bjut.edu.cn

© 2018 中国物理学会 Chinese Physical Society

#### http://wulixb.iphy.ac.cn

发生(电子-电子相互作用),而非电流带来的焦耳 热效应<sup>[15]</sup>.还有研究者搭建了VO<sub>2</sub>场效应管,以 1.2 V的门电压(V<sub>g</sub>)依靠离子液体(ions liquid)的 双电层在VO<sub>2</sub> 薄膜表面建立起10<sup>9</sup> V/m的电场, 通过瞬间载流子的注入触发相变实现晶体管的开 关控制,似乎证实了电场的载流子注入作用<sup>[16]</sup>.但 是,该结果也受到了其他研究者的质疑.原因在于, 在强大电场的作用下,氧空位、质子在离子液体和 VO<sub>2</sub>薄膜间发生的迁移形成了对VO<sub>2</sub>薄膜的电子 掺杂,导致了相变的发生<sup>[17–20]</sup>.因此,需要规避 离子液体,在无电流焦耳热的影响下,验证电场对 VO<sub>2</sub>MIT的触发作用.

深入研究 VO<sub>2</sub> 相变的物理机理,有助于更好地 调控 VO<sub>2</sub> 的相变温度,并能推广它的实际应用<sup>[4]</sup>. 本文利用原位透射电子显微技术 (*in situ* TEM), 探究电触发 VO<sub>2</sub> 单晶纳米线发生相变过程中电子 结构转变和晶体结构转变的解耦等现象,对电触发 VO<sub>2</sub> 发生 MIT 的相变机理从电子显微学角度做探 索性研究.

# 2 实验方法

本文通过物理气相运输法在管式炉中制备了 单晶VO<sub>2</sub>纳米线<sup>[21]</sup>.将VO<sub>2</sub>粉末放入刚玉坩埚 中,管式炉加热到1123 K, VO<sub>2</sub>粉末升华后经氩气 运输 (氩气流量 20 sccm (1 sccm=1 mL/min)) 在洁 净的硅片上生长出单晶 VO<sub>2</sub> 纳米线.

采用通电样品杆(下文简称电杆)在透射电镜 中研究电触发VO2相变.通过电杆可以给VO2纳 米线施加恒定的偏压或大小和方向均改变的交流 电压,并获得实时的伏安曲线.在实时记录的伏安 曲线中,相邻两个点的时间间隔(即时间分辨率)为 12.8 ms.原位通电实验在JEOL 2010透射电镜下 进行.在利用电杆给VO2纳米线通电的同时,使用 Gatan Oneview<sup>®</sup>超快相机每隔5 ms拍摄一张纳米 线的选区电子衍射谱,以记录通电过程中VO2纳米 线的结构变化.

# 3 实验结果和讨论

 $VO_2$ 在发生相变前后,其能带结构和晶体结构 都会发生变化,如图1所示.一般情况下,金属相为 金红石结构(rutile, R, *P4/mnm*),绝缘体相为单 斜结构(monoclinic, M<sub>1</sub>, *P2*<sub>1</sub>/*c*),其晶体结构模型 如图1(a)所示.将具有金属态能带结构的R相称 为metal R,将具有绝缘体能带结构的M<sub>1</sub>相称为 insulator M<sub>1</sub>,如图1(b)所示.当VO<sub>2</sub>为金属态时, V原子3d轨道和O原子的2p轨道杂化,形成轨道  $\pi^* 和 d_{||}$ 轨道,费米能级E<sub>f</sub>落在 $\pi^* 与 d_{||}$ 能带中,故 此时 VO<sub>2</sub>为金属相.当VO<sub>2</sub>为绝缘体态时, $\pi^*$ 轨道



图 1 VO<sub>2</sub> 在 R 和 M<sub>1</sub> 相的能带和晶体结构差异 (a) R 和 M<sub>1</sub> 相的晶体结构模型; (b) 费米能级附近 R 和 M<sub>1</sub> 两相的能带 结构; (c) 沿 [001]<sub>R</sub> 方向的 V 原子链排布; (d) 特定观察方向下 VO<sub>2</sub> R 和 M<sub>1</sub> 相存在差异的电子衍射模拟图 Fig. 1. The differences of energy band and crystal structure between R and M<sub>1</sub> phase: (a) Model of VO<sub>2</sub> crystal structure; (b) schematic of the VO<sub>2</sub> band structure near Fermi level ( $E_F$ ) in R and M<sub>1</sub>; (c) arrangement of V atoms chain in R and M<sub>1</sub> VO<sub>2</sub> along [001]<sub>R</sub>; (d) simulated VO<sub>2</sub> diffraction pattern from particular observation directions, from which the difference of phase R and M<sub>1</sub> can be seen.

能级提升,  $d_{||}$ 能带分裂为一个成键轨道 $d_{||}$ 和反键 轨道 $d_{||}^*$ ,电子全部进入能级水平较低的 $d_{||}$ 成为价 带.此时 VO<sub>2</sub>存在一个 0.7 eV 的带隙,故表现为半 导体的性质.这种能带电子结构转变称为 MIT<sup>[22]</sup>.

图 1 (c) 给出了 VO<sub>2</sub> 在 R 和 M<sub>1</sub> 两相中 V 原子的结构调整. 当 VO<sub>2</sub> 为四方金红石 R 相时, 沿金 红石结构的 c轴, 即  $[001]_R$  方向, V 原子为笔直的 链状排列, 相邻 V-V 原子之间为等间距. 当 VO<sub>2</sub> 从 R 相向 M<sub>1</sub> 相转变时, V 原子沿  $[001]_R$  和  $[110]_R$  方向跳跃, 发生二聚化 (dimerization) 和锯齿扭曲 (zigzag), 相邻 V-V 原子之间形成疏密相间的不等 间距, 结构对称性下降为单斜结构. 相变过程中, O 原子的位置几乎没有发生变化. 这种晶体结构的变 化称为 SPT <sup>[23,24]</sup>.

由于在VO<sub>2</sub>发生从R到M<sub>1</sub>的晶体结构转变 时,晶体中只是V原子的排列方式发生了稍许改 变,O原子位置几乎不变;所以,从大多数低指数 带轴观察时,转变前后的R相和M<sub>1</sub>相电子衍射是 完全相同的.但由于晶体衍射存在的系统消光现 象,从一些特定晶带轴进行观察时,R相和M<sub>1</sub>相存 在区别.通常表现为衍射花样整体相似,但在R相 中个别位置或整排的衍射斑点发生消光.图1(d) 列出了R和M<sub>1</sub>相有差异的三对晶带轴的电子衍射 模拟图.虽然每一对R相和M<sub>1</sub>相的带轴指数不同, 但对于VO<sub>2</sub>而言,两两都为相同的观察方向,从这 些晶带轴的电子衍射谱中易于分辨相变的发生.因 此,在用透射电子显微镜原位观察研究VO<sub>2</sub>晶体结 构相变时,通过记录电子衍射图就能够准确地判断 此时VO<sub>2</sub>对应的晶体结构是R相还是M<sub>1</sub>相.

利用物理气相输运法在硅片上制备的VO<sub>2</sub>纳 米线在光镜下的形貌如图2(a)所示.纳米线均匀 分布在硅基底上,既存在长度小于1µm且横截面 边长小于100 nm的小尺寸纳米线,也存在长度超 过30µm且横截面边长都在1µm以上的微米线. 扫描电镜观察显示:纳米线是横截面为矩形的长方 体,生长方向沿[001]<sub>R</sub>晶向,四个侧面均为{110}<sub>R</sub> 晶面(见图2(a)插图).考虑到电子束的穿透能力 有限,为了便于在透射电镜中观察,本文将选择截 面边长尺寸在几百纳米量级的纳米线进行实验.

在透射电镜中,利用电杆将 VO<sub>2</sub>纳米线接入 闭合回路,纳米线一端与固定端金电极连接,另一 端与可三维移动的、干净的钨针尖连接,如图 2 (b) 所示. 当透射电镜的电子束穿过纳米线给出 VO<sub>2</sub> 相结构的电子衍射谱时,可以实时而精确地测量到 回路中的电流电压.由于结构的差异,纳米线M<sub>1</sub> 相和R相在同一观察方向下的选区电子衍射花样 不同,如M<sub>1</sub>相的[01ī]<sub>M1</sub> 衍射图与R相的[1ī1]<sub>R</sub>衍 射图相比,多出了整排的衍射斑点(如图1(d)中模 拟衍射图和图2(d)中一插图的箭头所示).通过快 速相机记录的衍射花样的变化,可以判断VO<sub>2</sub>纳 米线相变的发生并确定相变发生的时刻.

在室温环境下,在纳米线两端施加-6—+6 V 的电压,电压随时间均匀变化,每隔12.8 ms记录 一个电流电压值,两点间电压的差值为0.012 V, 整个通电过程总共历时12.8 s,记录的伏安曲线如 图 2 (d) 所示.在给纳米线通电的同时,利用快速相 机每隔5 ms拍摄一张纳米线的选区电子衍射花样. 通过同时纪录 VO<sub>2</sub>纳米线的衍射花样和电流-电压 值,可以给出 VO<sub>2</sub>纳米线的衍射花样和电流-电压 值,可以给出 VO<sub>2</sub>纳米线伏安曲线中每个数据点的 相结构,如图 2 (d)中对应时间插入的电子衍射图 所示.整个过程总共发生了四次相变:起始电压为 -6 V时,VO<sub>2</sub>纳米线瞬间从M<sub>1</sub>相转变为R相;随 着电压逐渐减小,纳米线相变为M<sub>1</sub>相;当电压反向 增大后,纳米线再一次变为R相;最后在通电停止 时,VO<sub>2</sub>纳米线相变回到M<sub>1</sub>相.

在数据处理中,将快速相机记录的时间和伏安 曲线t = 0 s和t = 12.8 s这两个时间节点进行精 确的校准和比对分析,结果显示,发生第二次相变 时(图2(d)中绿色箭头所标示的点), VO2的电子 结构转变与晶体结构转变发生了解耦. 在图中绿 色箭头表示的时间点上,即t = 5.6576 s这一时刻, 电流已经明显减小,表示其电子结构处在绝缘相. 但该时间点前后记录到的两张电子衍射图(图2(d) 中绿色虚线框内的两张插图)标定出晶体结构均为 R相,由此可以判断此时纳米线的晶体结构仍为R 相,因此VO<sub>2</sub>纳米线是处于 insulator R 的状态. insulator R的电子结构和晶体结构如图2(d)右下角 插图所示. 即通电过程中电压值减小到-0.696 V 时,纳米线电子结构已经发生变化,d<sub>11</sub>能带分裂, 价带和导带之间出现了带隙;然而,从电子衍射图 判断此时纳米线仍是R相,也就是说晶体结构尚未 发生变化. 在此次从 metal R 到 insulator M<sub>1</sub>相变 中,电子结构转变(metal到insulator)先于晶体结 构转变(R相到M1相)发生,两者发生了解耦,出现 了 insulator R 的状态.

第三次相变对应的是 insulator  $M_1$  到 metal R

转变,即在t = 7.8080 s的时刻,电流突然增大,说 明VO<sub>2</sub>已处于金属相.但由于伏安曲线的分辨率 不足,电流电压时间的记录点与电子衍射的记录 点并不完全重合.该时刻之前记录到的电子衍射 图显示晶体结构为M<sub>1</sub>相,之后的电子衍射图显示 结构为R相,如图<sup>2</sup>(d)中橙黄色虚线框内的两张 插图所示.因此,无法准确判断此时刻VO<sub>2</sub>所处的 晶体结构,即第三次相变无法确定电子结构转变 (insulator 到 metal)是否先于晶体结构转变(M<sub>1</sub> 相 到R相),无法获知是否有 metal M<sub>1</sub>的状态.

进一步将三根不同VO<sub>2</sub>纳米线样品分别连入 电路,对纳米线两端施加电压后得到了三组不同 的电流随电压变化的曲线,如图2(c)所示.在纳米 线两端施加初始电压为-5V(即金电极一端电势 较低),之后施加电压的绝对值随时间而线性减小, 同时记录电路中对应的电流值.在这三条伏安曲 线中,都在电压减小到-1V左右时,出现了电流 值的突变,这是由于电阻值突然增大导致的.说明 VO2在此时由金属相瞬间转变为绝缘相.需要指 出的是,通过对电杆控制模块的设置,在电路中采 用了补偿机制,补偿机制在这里可以简化理解为一 个滑动变阻器,如图2(b)所示,电流上限被设定为 103.5 μA.当电流值超过103.5 μA时,补偿机制生 效,使电流维持这一数值;当电流小于103.5 μA时,



图 2 (a) 物理气相输运法制备的 VO<sub>2</sub> 纳米线的光镜和 SEM 照片; (b) 电触发 VO<sub>2</sub> 纳米线发生金属-绝缘体相变的电路装置示 意图; (c) 电加载 VO<sub>2</sub> 纳米线的伏安曲线; (d) 电触发 VO<sub>2</sub> 纳米线发生相变过程中的电子结构和晶体结构变化, 伏安曲线上通过 颜色标识每一点的相结构, 蓝色表示 R 相, 红色表示  $M_1$  相, 黄点表示 R 与  $M_1$  相共存的点, 绿色箭头标示了解耦的位置, 在该 点电子结构先于晶体结构变化, 即 insulator R, 衍射图为不同时刻对应的 VO<sub>2</sub> 选区电子衍射图样, 插图为绿色箭头所指的点对 应的能带和晶体结构示意图

Fig. 2. (a) Optical microscopy and SEM images of VO<sub>2</sub> nanowires prepared by method of physical vapor transportation; (b) scheme of the experimental setup to trigger the phase transition of VO<sub>2</sub> nanowire electrically using electrical holder under TEM; (c) voltage-current curve of VO<sub>2</sub> nanowires; (d) the electron structure transition and phase transition recorded simultaneously. The phase composition of every points in the *I-V* curve is shown with different colors, blue for R, red for M<sub>1</sub> and yellow for probability of coexistence of M<sub>1</sub> and R. The green arrow indicates the point which is decoupled with electron structure transition prior to phase transition, the selected area electron diffraction patterns of VO<sub>2</sub> from different time is shown; inset illustration shows the structure of insulator R.

补偿机制停止工作.之所以引入这一补偿机制, 是为了探究焦耳热在VO2相变过程中所起到的作 用. 发生相变之前, 由于电路中最大电流始终被 限制在103.5 µA, 在纳米线两端电压逐渐减小的 过程中,纳米线本身所产生的焦耳热Q保持不变  $(Q = I^2 R)$ ,即产生的焦耳热并未减少,只是纳米 线两端的电势差在逐渐减小. 当电势减小到纳米 线中的载流子浓度不足以抵消电子库仑屏蔽作用 时,发生metal R到insulator R再到insulator M<sub>1</sub> 相变;在纳米线刚刚发生MIT之后,由于M1相电 阻比R相电阻大4-5个数量级,估算其产生的焦 耳热会有明显增加.因而,即使考虑到通电过程 中持续产生的焦耳热可能导致纳米线有温升现象, 但实验中所发生的从R到M<sub>1</sub>相变过程是从高温 相到低温相的转变.这一结果证明,在电致VO2 相变的过程中,并非是电流产生的焦耳热引发了 VO2相变;相变的产生与电势差的逐渐减小、通 过VO2的载流子浓度逐渐降低有关. 当载流子浓 度不足以支撑VO2维持金属性时, VO2瞬间发生 MIT, 进而再发生R相到M<sub>1</sub>相的SPT. 即VO<sub>2</sub>的 电致相变是由载流子注入所致而非焦耳热作用 引发的.

由图 2 (c) 和图 2 (d) 还可以看出, VO<sub>2</sub> 纳米线 两端的电压达到临界值后, 电流突然飙升或锐减, 表明 VO<sub>2</sub> 纳米线整体同时相变, 并不存在因不均匀 氧空位掺杂而引起的逐渐相变化<sup>[1]</sup>. 这说明利用物 理气相输运法制备的 VO<sub>2</sub> 纳米线含有氧空位等缺 陷较少, 因此, 在电场的作用下并没有发生因氧离 子输运 (或氧空位迁移) 而触发的相变.

结合透射电镜中电杆控制和超快电子衍射鉴 定结果,可以对电触发VO2相变的机理进行探讨. 通过记录VO2纳米线通电相变过程中的电流电压 曲线,验证了焦耳热不是引起VO2相变的原因,同 时推测是足够量的载流子注入引发了VO2发生相 变.此外,在电触发单晶VO2纳米线的MIT过程 中,还发现电子结构转变先于原子结构转变的解耦 现象.值得一提的是,该实验设计不同于以往VO2 薄膜的实验设计<sup>[7,14]</sup>,VO2单晶纳米线由于没有基 底束缚,其相变过程是VO2本征的相转变过程,没 有受到外界应力应变的调制,进一步说明VO2的 MIT 是电子-电子相互作用主导下的相转变过程. 强关联体系VO2中,电子间存在较强的库仑斥力, 电子间的库仑势能大于电子的动能,电子被局域 化, VO<sub>2</sub>表现为绝缘体; 电子载流子注入可以提高 电子的动能, 当达到临界载流子浓度时, 库仑屏蔽 被打破, 电子离域化触发相变发生. 原子结构调整 似乎是伴随电子结构调整而调整的. 这一结果也支 撑了对于电触发VO<sub>2</sub>相变的原因是载流子注入的 猜测.

当VO<sub>2</sub>纳米线处于闭合回路中时,两端既有 电压,又有电流通过.为了进一步验证电触发VO2 相变过程中载流子的作用,排除因电流产生焦耳热 对纳米线的影响,本文尝试采用非接触式的方法在 纳米线上施加电场. 借助透射电镜中的电杆, 设计 实施了单纯施加外场而无电流通过纳米线的实验, 如图3(a)所示. VO2纳米线一端通过无定形SiO2 与金电极相连, SiO2为介电层, 用钨针尖接近、但 不接触到悬臂梁VO2纳米线的另一端,通过在金电 极和钨针尖之间的电势差来给VO2纳米线两端施 加电场而无电流通过. 图3(b)展示了实际实验设 置的透射电镜照片,插图为钨针尖接近纳米线端部 时的情况. 实验中, 逐渐增大纳米线两端施加的偏 压,通过实时记录纳米线的电子衍射谱来判断其是 否发生相变.图3(c)分别是VO2处于M1相和R相 时对应的选区电子衍射花样模拟图,其晶带轴方向 与图3(d)中实验观察的晶带轴方向相同.图3(d) 分别是在偏压为0.90和140V时拍摄的VO。纳米 线的电子衍射图,标定显示均为M<sub>1</sub>相.即偏压一 直增加到140 V时也没有观察到VO2纳米线发生 M1 到 R 相变, 说明在这样的加载方式和电场强度 下, VO<sub>2</sub> 纳米线无法发生相变.

VO<sub>2</sub>纳米线虽然没有产生相变,但VO<sub>2</sub>在电 场作用下会发生正负电荷中心的分离.图4(a)为 不同强度的电场下,VO<sub>2</sub>纳米线与钨针尖的相对位 置情况.此时钨针尖,纳米线和金电极的摆放位置 如图4(b)所示.可以看到,纳米线两端电场强度越 大,纳米线偏离起始位置越多;当电压恢复为0V 时,纳米线重新回到起始位置,在整个过程中VO<sub>2</sub> 没有发生相转变.纳米线偏移是由于在外电场作用 下,VO<sub>2</sub>纳米线的表面产生极化电荷,即负二价的 氧离子和正四价的钒离子偏离平衡位置,导致VO<sub>2</sub> 正负电荷中心分离,产生电偶极子.由于在沿着纳 米线的方向(即图中水平方向)有SiO<sub>2</sub>和金电极链 接固定,纳米线无法发生水平移动,故只需考虑电 场在垂直纳米线方向的分量.纳米线极化的机理 如图4(c)所示,下方的钨针尖类似于一个点电极, 纳米线所处的电场并非均匀的,在接近点电极处电场方向有偏折,此时被极化的纳米线在电场中会受到竖直向下的电场力<sup>[25]</sup>,造成纳米线发生移动.

这个结果说明,尽管纳米线在电场下发生了极化, 表面有束缚电荷存在,但并不足以引发整体结构的 相变.



图 3 (a)利用电杆对纳米线施加电场的装置结构示意图; (b)装置的 TEM 照片,已染色; (c) 模拟 M<sub>1</sub> 相 [211]带轴下的电子衍射和同一方向 VO<sub>2</sub>转变为 R 相后的选区电子衍射; (d)不同偏压下的 VO<sub>2</sub> 纳米线的电子衍射

Fig. 3. (a) The experiment setup of applying a bias on nanowire under TEM; (b) TEM images (false color) of  $VO_2$  nanowire in the electric field; (c) simulated  $VO_2$  diffraction pattern observed from [211] zone axis of  $M_1$  phase and diffraction pattern of R phase from the same view direction; (d) diffraction patterns of  $VO_2$  nanowire under different bias.



图 4 (a) 不同电压下纳米线相对钨针尖位移情况的 TEM 照片, 已染色; (b) 对纳米线施加电场的装置结构示意图; (c) 纳米线 在垂直分量电场下有偏移的原理示意

Fig. 4. (a) The nanowire moves toward W tip gradually with increased bias, TEM images with false color; (b) the experiment setup of applying a bias on nanowire under TEM; (c) schematic diagram of the shift of nanowire under vertical electric field.

由于无法定量透射电镜电杆所施加的电场,进 一步设计了用平行电极对纳米线进行非接触式施 加电场的实验. 图 5(a) 是实验装置示意图, VO<sub>2</sub> 纳 米线放在两个平行金电极构建的均匀电场中,整个 装置放置于光镜下进行显微观察. 由于M和R相 对红外到近红外波段的透过率有很大差异,两相在 光源为白光的光镜下会显示不同的颜色,如图5(b) 所示, 直径约300 nm的VO2纳米线在基底应力作 用下相变后形成的M和R两相竹节状结构可在光 镜下清楚分辨出来,所以可以通过颜色变化来判 断纳米线相变的发生. 图5(c)是通过两个平行金 电极对纳米线加载不同强度的电场时的光学显微 镜图片,可以看到,从0-6 V逐渐增大纳米线两端 的电场,光镜下并没有看到纳米线发生相变.由于 VO<sub>2</sub>纳米线在电场中会发生极化的现象,因此对 VO<sub>2</sub>纳米线中的表面束缚电荷进行了估算. 设极板 间的电压为U,极板间距为d,相应的外电场强度为  $E_0$ ,

$$E_0 = U/d,\tag{1}$$

将实验中的数据U = 60 V, d = 5 µm 代入(1) 式, 对应的外场强度为 $E_0 = 1.2 \times 10^7$  V/m. 在外 电场作用下, VO<sub>2</sub> 被极化, 正负电荷分离, 产生表 面束缚电荷 $\sigma$ , 存在附加退极化场E', 方向与外电 场相反. 宏观电场 E 为

$$E = E_0 + E' = E_0/\varepsilon_r = 3.3 \times 10^5 \text{ V/m},$$
 (2)

其中 VO<sub>2</sub> 的相对介电常数为 $\varepsilon_r = 36^{[26]}$ ,在垂直外电场方向的两个侧面产生的束缚电荷 $\sigma$ 为

$$\sigma = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E. \tag{3}$$

将真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$  F/m代入(3) 式,得到 $\sigma = 6.4 \times 10^{10}$  e/cm<sup>2</sup>,该数值可以理解为 电场直接注入、掺杂的载流子浓度.该数值小于文 献中约10<sup>13</sup> e/cm<sup>2</sup>的诱发相变的电子浓度阈值<sup>[27]</sup>, 因此纳米线未发生相变的原因是电场强度不够大, 导致因极化注入的载流子浓度不足.

尽管分别在光镜下和透射电镜中尝试了通过 在纳米线周围加强电场来引发纳米线相变的实验, 但受到最大加载电压的限制,没有看到相变发生. 但是仍观察到了VO<sub>2</sub>纳米线在电场中的偏移现象, 证明了外加电场对VO<sub>2</sub>纳米线的极化作用. 尽管 外加电场的作用造成了VO<sub>2</sub>正负电荷中心发生分 离,产生了一定量的表面束缚电荷,但由此所提供 的载流子浓度还不足以导致相变. 在今后的研究 中,还需通过改进实验设计提高电场强度,进一步 验证电场引发VO<sub>2</sub>相变的结果.



图 5 (a) 实验装置示意图; (b) 长在 Si 基底上的 VO<sub>2</sub> 纳米线在加热到 338 K 时相变形成的两相竹节结构; (c) 在 VO<sub>2</sub> 纳米线上施加平行电场的光镜照片

Fig. 5. (a) Scheme of the device in experiment; (b) the M-R domain structure in VO<sub>2</sub> nanowire at 338 K; (c) optical microscope images of VO<sub>2</sub> nanowire set in the parallel electric field.

# 4 结 论

本文通过设计实验,在无任何衬底影响的条件 下,对电触发VO2相变的电子结构和晶体结构相变 解耦现象和焦耳热效应影响进行了研究和讨论.结 合通电样品杆和超快相机技术,在透射电镜中对单 晶VO<sub>2</sub>纳米线进行接触式通电,同步记录了伏安曲 线和电子衍射数据,观察到在毫秒尺度下,VO2由 metal R到insulator M<sub>1</sub>相变过程中存在insulator R状态,即存在电子结构和晶体结构相变解耦.通 过控制电路中的最大电流,使得单晶VO<sub>2</sub>纳米线 产生的焦耳热不随两端电势差的降低而减小,证明  $VO_2$ 纳米线在由高温相R到低温相 $M_1$ 的相变瞬 间,引起VO2相变的原因并非焦耳热变化导致的热 致相变. 实验结果表明, VO2 相变是由于载流子注 入使 VO2 电子结构率先变化, 原子结构随电子结构 的调整而调整,从而使得相变发生.此结果倾向于 VO<sub>2</sub> MIT 相变是在电子-电子关联机制下进行的, 即Mott转变.在VO2纳米线两端施加非接触式强 电场,没有电流通过时,虽然未发现相变,但观察 到纳米线因电场极化而出现的移动,即存在表面束 缚电荷,为进一步研究电场引发VO2相变提供了 基础.

#### 参考文献

- Zhang Z H, Guo H, Ding W Q, Zhang B, Lu Y, Ke X X, Liu W W, Chen F R, Sui M L 2017 Nano Lett. 17 851
- [2] Joyeeta N, Haglund Jr R F 2008 J. Phys. Condens. Matter 20 264016
- [3] Lopez R, Feldman L C, Haglund Jr R F 2004 Phys. Rev. Lett. 93 177403
- [4] Luo M H, Xu M J, Huang Q W, Li P, He Y B 2016 Acta Phys. Sin. 65 047201 (in Chinese) [罗明海, 徐马记, 黄其 伟, 李派, 何云斌 2016 物理学报 65 047201]
- [5] Zylbersztejn A, Mott N F 1975 $Phys.\ Rev.\ B$ 11 4383
- [6] Tan X G, Yao T, Long R, Sun Z H, Feng Y J, Cheng H, Yuan X, Zhang W Q, Liu Q H, Wu C Z, Xie Y 2012 Sci. Rep. 2 466
- [7] Morrison V R, Chatelain R P, Tiwari K L, Hendaoui A, Bruhács A, Chaker M, Siwick B J 2014 Science 346 445

- [8] Laverock J, Kittiwatanakul S, Zakharov A, Niu Y, Chen B, Wolf S, Lu J, Smith K 2014 *Phys. Rev. Lett.* 113 216402
- [9] Zhang S, Chou J Y, Lauhon L J 2009 Nano Lett. 9 4527
- [10] Kumar S, Strachan J P, Pickett M D, Bratkovsky A, Nishi Y, Williams R S 2014 Adv. Mater. 26 7505
- [11] Driscoll T, Quinn J, Massimiliano D V, Dimitri N B, Seo G, Lee Y W, Kim H T, David R S 2012 *Phys. Rev. B* 86 094203
- [12] Nakano M, Okuyama D, Shibuya K, Mizumaki M, Ohsumi H, Yoshida M, Takata M, Kawasaki M, Tokura Y, Arima T, Iwasa Y 2015 Adv. Electron. Mater. 1 1500093
- [13] Zimmers A, Aigouy L, Mortier M, Sharoni A, Wang S, West K, Ramirez J, Schuller I K 2013 *Phys. Rev. Lett.* 110 056601
- [14] Qiu D H, Wen Q Y, Yang Q H, Chen Z, Jing Y L, Zhang H W 2013 Acta Phys. Sin. 62 217201 (in Chinese) [邱东 鸿, 文岐业, 杨青慧, 陈智, 荆玉兰, 张怀武 2013 物理学报 62 217201]
- [15] Wu B, Zimmers A, Aubin H, Ghosh R, Liu Y, Lopez R 2011 Phys. Rev. B 84 241410
- [16] Nakano M, Shibuya K, Okuyama D, Hatano T, Ono S, Kawasaki M, Iwasa Y, Tokura Y 2012 Nature 487 459
- [17] Jeong J, Aetukuri N, Graf T, Schladt T D, Samant M G, Parkin S S 2013 *Science* 339 1402
- [18] Ji H, Wei J, Natelson D 2012 Nano Lett. 12 2988
- [19] Shibuya K, Sawa A 2016 Adv. Electron. Mater. 2 1500131
- [20] Jeong J, Aetukuri N B, Passarello D, Conradson S D, Samant M G, Parkin S S 2015 Proc. Natl. Acad. Sci. 112 1013
- [21] Ding W Q, Zhang Z H, Guo Z X, Sui M L 2014 J. Chin. Electron Microsc. Soc. 33 406 (in Chinese) [丁文强, 张 振华, 郭振玺, 隋曼龄 2014 电子显微学报 33 406]
- [22] Perrine C, Jérôme R, Valérie B, Murielle S, Olivier P, Vivian N, Luca O, Jean S, Hazemann J L, Bottero J Y 2007 J. Phys. Chem. B 111 5101
- [23] Zhang S X, Kim I S, Lauhon L J 2011 Nano Lett. 11 1443
- [24] Gao Y, Cao C, Dai L, Luo H, Kanehira M, Ding Y, Wang Z L 2012 Energy Environ. Sci. 5 8708
- [25] Gao P, Kang Z C, Fu W Y, Wang W L, Bai W D, Wang E G 2010 J. Am. Chem. Soc. 132 4197
- [26] Wan X G, Turner A M, Vishwanath A, Savrasov S Y 2010 Phys. Rev. B 82 205101
- [27] Takeaki Y, Tomonori N, Akira T 2015 Nat. Commun. 6 10104

# Mechanism of electrically driven metal-insulator phase transition in vanadium dioxide nanowires<sup>\*</sup>

Wang Ze-Lin<sup>1)</sup> Zhang Zhen-Hua<sup>2)</sup> Zhao Zhe<sup>1)</sup> Shao Rui-Wen<sup>3)</sup> Sui Man-Ling<sup>1)†</sup>

1) (Institute of Microstructure and Properties of Advanced Materials, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

2) (Innovative Center for Advanced Materials (ICAM), Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China)

3) (Electron Microscopy Laboratory, School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China)

( Received 26 April 2018; revised manuscript received 20 May 2018 )

#### Abstract

Vanadium dioxide  $(VO_2)$  is well known for its metal-insulator transition (MIT) at 341 K. Normally, the  $VO_2$ presents a metallic rutile (R) phase above the  $T_c$ , but an insulator (monoclinic, M) phase below the  $T_c$ . Besides the thermally driven mode, the phase transition can also be triggered electrically, which is common in electron devices like field effect transistors and actuators. Due to the electron correlation, the Mott transition associated with electronelectron interaction as well as the Peierls transition involving electron-lattice interaction are both believed to drive the transition of VO<sub>2</sub>, although the actual MIT mechanism is still under debate in condensed matter physics. The Coulomb screening of the electron hopping can be broken by injecting enough carriers. However, the issue is more complicated in the electrically-triggered MIT of VO<sub>2</sub> due to the Joule heat of current and the carrier injection of field effect. In this work, we study the electrically induced MIT in  $VO_2$  nanowires by *in-situ* transmission electron microscopy (TEM). We build a closed circuit under the TEM by using in-situ electric TEM holder to capture the changes of VO<sub>2</sub> in electron structure and phase structure simultaneously. An alternating bias voltage is applied to the  $VO_2$  nanowire while the selected area electron diffraction (SAED) patterns of VO<sub>2</sub> nanowire are recorded using Gatan Oneview<sup>®</sup> fast camera. The current rises or drops suddenly in the current-voltage curve (I-V curve), indicating a phase transition, through which the SAED pattern of nanowire is recoded every 5 ms. By correspondence analysis between the SAED patterns and the I-V data at every moment, a transition state of insulating R phase is observed, which is obviously different from the normal state of the metallic R phase or the insulating M phase. The existence of the insulating R phase indicates that electron structure transforms prior to the phase transition. The decoupling phenomenon reveals a predominant role of electron-electron interaction. Moreover, by feedback strategy of the circuit, the current through the metallic nanowire of  $VO_2$  remains unchanged, and thus keeping the Joule heating in the nanowire constant, the phase transition from metal to insulator does not happen until the voltage decreases to about 1 V. When phase transition to insulator happens in voltage stepdown, even stronger Joule heating is generated because of the increased resistance of VO<sub>2</sub> nanowire. Therefore, the VO<sub>2</sub> phase transition is triggered electrically by the carrier injection instead of the Joule heating. The injecting of enough carriers can break the screening effect to activate the electron hopping and initiate the phase transition. The deduction is confirmed by the decoupling phenomenon in the insulating R phase. Additionally, the polarized shift rather than the phase transition of the  $VO_2$  nanowire is observed in the non-contact electric field mode, which also supports the cause of the carrier injection for the electric induced MIT. The results prove the electron-correlation-driven MIT mechanism, or so called Mott mechanism, and open the new way for electron microscopy used to study the electron correlated MIT.

**Keywords:** vanadium dioxide, metal-insulator phase transition, Mott transition, *in-situ* transmission electron microscopy

**PACS:** 72.80.Ga, 71.30.+h, 73.63.-b, 68.37.Lp

**DOI:** 10.7498/aps.67.20180835

<sup>\*</sup> Project supported by the National Key Research and Development Program of China (Grant No. 2016YFB0700700), the Science Fund for Creative Research Groups of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 51621003), and the Key Project of Beijing Natural Science Foundation, China (Grant No. KZ201310005002).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: mlsui@bjut.edu.cn